

ナノ・マイクロマテリアル分析研究室利用細則 別表

令和3年9月1日 施行

1 利用料の算定基準となる利用時間は時間単位とし、1時間未満は1時間とする。

2 利用料

2-1 文科省ナノテクノロジープラットフォーム事業 *(1)

(円/時間)

(装置利用料/技術代行料) 設 備	型 式	装置利用料 *(2)				技術補助料 *(3)			技術代行料 *(4)		
		学内利用者	学外利用者			学内利用者	学外利用者		学内利用者	学外利用者	
			初回講習料	大学・公的機関	一般		大学・公的機関	一般		大学・公的機関	一般
電界放射走査電子顕微鏡(FE-SEM)	JSM-6500F	1,200	35,200	1,600	4,000	5,200	6,000	8,400	9,200	10,400	12,800
環境セル対応電子顕微鏡システム(TEM)	JEM-2010	1,100	35,200	1,500	4,100	5,100	5,900	8,500	9,100	10,300	12,900
電子プローブマイクロアナライザ(FE-EPMA)	JXA-8530F	2,100	35,200	3,100	8,800	6,100	7,500	13,200	10,100	11,900	17,600
複合ビーム加工観察装置(FIB-SEM)	JIB-4600F/HKD	2,300	35,200	2,900	5,400	6,300	7,300	9,800	10,300	11,700	14,200
複合ビーム加工観察装置(FIB-SEM)EDS・EBSOオプション	JED-2300(EDS) IB-Z10053T3DEBS(EBSO)	400		500	900	400	500	900	400	500	900

技術支援料 *(5)	4,400 (8,800)
技術相談料 *(6)	11,000

*(1) 文科省ナノテクノロジープラットフォーム事業利用の場合、別途、支援課題申請書および報告書の提出が必要。

*(2) 設備利用料. 利用対象者が本学において自ら設備の操作等を行う。

*(3) 技術補助料. 利用対象者が本学において本事業の実施に係る支援業務に携わる職員(以下この条において「支援員」という。)の立会いの下、支援員の技術的な補助を受けつつ、自ら設備の操作等を行う。

*(4) 技術代行料. 利用対象者からの委託に基づき、支援員が設備を操作して各種加工及び解析を行う。

*(5) 技術支援料. 技術代行による利用に先立ち、支援員が試料の調整又は最適化の作業を行う。(高度な知識及び経験を必要とされる作業、複数の技術を組み合わせる作業その他の難易度の高い作業を伴う場合にあっては¥8,800円)

*(6) 技術相談料. 利用対象者からの相談に対し、支援員が技術的な助言等を行う。

2-2 工学部自主事業

(円/時間)

設 備 (装置利用料/機器分析受託サービス利用料)	型 式	装置利用料 *(1)		機器分析受託サービス利用料 *(2)	
		学内利用者	学内利用者	学外利用者	
				大学・公的機関	一般
透過型電子顕微鏡(TEM)	JEM-2010X	1,000	5,000	6,600	7,260
エネルギー分散型蛍光X線分析装置(XRF)	JSX-3100R II	1,300	5,300	6,270	6,820
粒子径分布測定装置	MT3300EX II	800	4,800	5,720	6,160
クロスセクションポリリッシャ(CP)	SM-09010	600	4,600	5,170	6,050
イオンスライサ(薄膜試料作製装置)	EM-09100IS	600	4,600	8,030	5,390
Gentle Mill 3HI	Technoorg Linda製	2,500	6,500	7,200	9,020
電界放射走査電子顕微鏡(FE-SEM)	JSM-6500F	1,300	5,300	/	
電界放射走査電子顕微鏡(FE-SEM)	JSM-7200F	2,100	10,100		
環境セル対応電子顕微鏡システム(TEM)	JEM-2010	1,200	5,200		
電子プローブマイクロアナライザ(FE-EPMA)	JXA-8530F	2,200	6,200		
複合ビーム加工観察装置(FIB-SEM)	JIB-4600F/HKD	2,400	6,400		
複合ビーム加工観察装置(FIB-SEM)EDS・EBSDオプション	JED-2300(EDS) IB-Z10053T3DEBS(EBSD)	400	400		
マイクロピクアップシステム	Axis Pro	1,500	9,500		
不活性雰囲気サンプリング装置	Axis Pro	2,100	10,100	11,110	11,770
XRF フィルム代	消耗品 (課金単価: 円/1試料)	360	360	396	396
TEM グリッドメッシュ(Cu)	消耗品 (課金単価: 円/1枚)	410	410	451	451
TEM グリッドメッシュ(Mo)	消耗品 (課金単価: 円/1枚)	2,260	2,260	2,486	2,486

*(1) 装置利用料は利用者が自ら設備の操作等を行う利用について適用する。

*(2) 機器分析受託サービス利用料は利用者の委託または指示により、専任の技術者が設備の操作等を行う利用について適用する。

2-3 北海道大学オープンファシリティプラットフォーム事業

(円/時間)

(装置利用料/技術代行料) 設 備	型 式	予約利用料 *(1)					材料分析・加工料 *(2)			
		学内利用者		学外利用者			学内利用者		学外利用者	
		部局内	部局外	初回講習料	大学・公的機関	一般	部局内	部局外	大学・公的機関	一般
電界放射走査電子顕微鏡(FE-SEM)	JSM-6500F	1,400	1,400	35,200	4,900	6,400	9,400	9,400	13,700	15,200
環境セル対応電子顕微鏡システム(TEM)	JEM-2010	1,300	1,300	35,200	5,000	6,500	9,300	9,300	13,800	15,300
電子プローブマイクロアナライザ(FE-EPMA)	JXA-8530F	2,500	2,500	35,200	10,700	13,900	10,500	10,500	19,500	22,700
複合ビーム加工観察装置(FIB-SEM)	JIB-4600F/HKD	3,900	4,000	35,200	9,700	12,600	11,900	12,000	18,500	21,400
複合ビーム加工観察装置(FIB-SEM)EDS・EBSOオプション	JED-2300(EDS) IB-Z10053T3DEBS(EBSO)	800	400	/	1,100	1,500	8,400	8,400	9,900	10,300
粒子径分布測定装置	MT3300EX II	800	800	35,200	1,300	1,700	4,800	4,800	5,700	6,100
透過型電子顕微鏡(TEM)	JEM-2010	1,000	1,000	35,200	2,100	2,700	5,000	5,000	6,500	7,100
エネルギー分散型蛍光X線分析装置(XRF)	JSX-3100R II	1,300	1,300	35,200	2,200	2,800	5,300	5,300	6,600	7,200
クロスセクションポリッシャ(CP)	SM-09010	600	600	35,200	1,500	2,000	4,600	4,600	5,900	6,400
イオンライザー(薄膜試料作成装置)	EM-09100IS	600	600	35,200	800	1,100	4,600	4,600	5,200	5,500

*(1) 予約利用料は利用者が自ら設備の操作等を行う利用について適用する。

*(2) 材料分析・加工料は利用者の委託または指示により、専任の技術者が設備の操作等を行う利用について適用する。